



微小領域の高精度画像寸法測定

テレセントリック光学系による高精度な寸法測定と画像解析をご提案します。

特徴

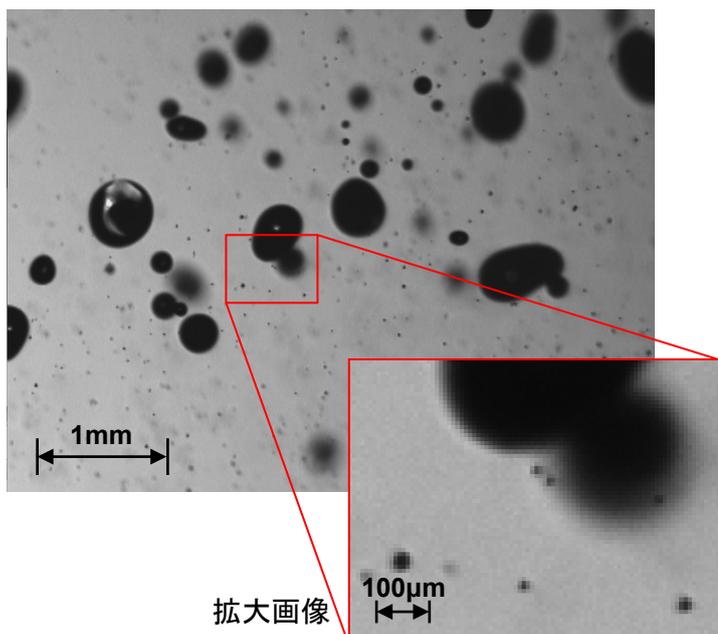
- 寸法測定に適したテレセントリック光学系を用いることで μm オーダの分解能で画像からの高精度な寸法測定が可能です。
- テレセントリック光学系では数100mmのワーキングディスタンスを確保できるため、比較的離れた位置からでも微小な領域を撮影することができます。
- 可搬式の装置のため、各種設備やテストベンチでのオンサイト計測に対応できます。
- ご希望の可視化対象に特化した画像解析ソフトのオーダーメイドも可能です。



カメラとレンズの例

微小領域撮影事例

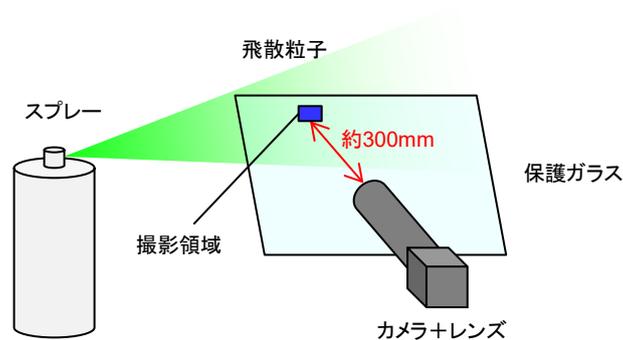
- スプレー噴霧時の飛散粒子



拡大画像

※静止画・動画のどちらも撮影可能です。

悪環境下でも数100mmの距離をとり、ガラス越しに撮影可能です ⇒ 工場設備などにも対応します



撮影距離	約300mm
撮影領域	5.0 × 3.7mm
解像度	720 × 540pixel
分解能	6.9 μm /pixel
その他	撮影フレームレート: 440fps、露光時間: 20 μs

画像解析について

- 変形・変位量解析・・・荷重や温度変化で発生する変形・変位量を画像から測定します。
- 物体の移動距離・速度解析・・・移動する物体の連続撮影画像から移動距離・速度を解析します。

これらの画像解析に対応するソフトウェアも作成できます。詳しくはお問合せ下さい。



JFE テクノリサーチ 株式会社

<https://www.jfe-tec.co.jp>

0120-643-777

Copyright ©2020 JFE Techno-Research Corporation. All Rights Reserved.
本資料の無断複製・転載・webサイトへのアップロード等はおやめ下さい。